

講演会の御案内

- 日時:平成24年2月28日(火)14:00~
- 場所:J2棟3階 J233
- 講師:石橋 隆幸 (長岡技術科学大学物質・材料系・准教授)
- 演題:「磁気光学効果を利用した磁気イメージング」
 - 磁気光学効果を利用したイメージングは、古くから磁性体の磁区構造を観察する方法として用いられてきた。最も簡単な観察法は、一般的な偏光顕微鏡を使った方法である。この方法では、試料面に垂直な磁区の観察が可能である。これに対して、若干の光学系を変更すれば、試料面内方向の磁区を観察することも可能である。さらには、近接場を利用することによって光の回折限界を超えた高い空間分解能を得ることができる。この他、磁気光学効果を示さない材料については、面内磁化の磁性ガーネット膜を転写膜として試料からの漏洩磁界を可視化する方法もある。本講演では、磁気光学効果を使った磁気イメージング法について紹介する。
- 問合せ:応セラ研 伊藤・谷山研究室 谷山 智康(5632)